

- **Nombre ponente:** Ing Carlos Segovia, Mexico.
- **Pasaporte/Cédula:** G11698596 ([Imagen pasaporte](#))
- **C.V y perfil profesional:** [C.V. Ver aquí.](#)

Resumen: Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica ESIME-IPN 1975-1980. Entre 1981-2000. Ha recibido más de 50 diversos cursos de capacitación en las áreas de Microscopía Electrónica, Microscopía de Fuerza Atómica análisis EDS, WDS y preparación de muestras en diversas compañías de Estados Unidos y Europa. De 1995 a 2015 ha impartido más de 120 cursos en áreas de Microscopía Electrónica, Microscopía de Fuerza Atómica en universidades de México, Ecuador, Argentina, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, así como en diversos congresos internacionales. Es miembro de la Asociación Mexicana de Microscopía, de la Microcopy Society of America (MSA) y de la Red Panamericana de Microscopía y Espectroscopia de Nano estructuras (REPAMINA). Es socio fundador de: Micra Ingeniería SA de CV Micra Nanotecnología SA de CV nLab: Laboratorio de Microscopía de Alta Resolución. Empresas todas ellas establecidas en México.

- **Título de la charla y resumen:** Una nueva aproximación de microscopía correlativa: Raman/SEM.

Resumen: Desde hace algunos años se ha intentado obtener imágenes simultáneas de microscopía Raman con imágenes de SEM, una nueva aproximación técnica hace que la obtención de imágenes correlativas con estas dos técnica se haga de manera fácil y obteniendo los benéficos de la observación en alta resolución de ambas técnicas. Se expondrán ejemplos de aplicación tanto en el área de ciencias biológicas como en el estudio de ciencia de los materiales.

- **Foto:**